

高純度水素中の硫黄化合物の分析

Agilent 8890 ガスクロマトグラフおよび Agilent 8355 化学発光硫黄検出器を使用

著者

Youjuan Zhang and Jie Zhang Agilent Technologies Shanghai, China

概要

高純度水素中の硫黄化合物の分析を、Agilent 8890 ガスクロマトグラフィー (GC) システムに Agilent 8355 化学発光硫黄検出器 (SCD) を組み合わせて実施しました。6 ポートガスサンプリングバルブを 使用して、システム全体にサンプルを導入しました。Agilent J&W DB-Sulfur SCD カラムの使用により、 優れたピーク形状と分離能が得られました。良好な直線性、再現性、検出下限 (LOD) が得られ、相 関係数 (R²) は 0.9983 以上、LOD はすべての成分に対して約 10 ppb でした。ピーク面積の標準的 なパーセント相対標準偏差 (RSD) は 0.87 ~ 12.54 % でした。

はじめに

水素は、高い発熱量とクリーンさにより、グリー ンエネルギーの好ましい供給源の1つとなっ ています。天然ガス、石炭、バイオマス、水の 電気分解など、水素はさまざまな資源から生 成できます。しかし、比較的低コストで、より 成熟した技術であることから、化石燃料から 水素を製造することが依然として最も一般的 な方法となっています。

原材料や反応プロセスによって、水素製品に 不純物が混入する可能性があります。一般的 な不純物には、CO、CO₂、NH₃、硫黄、ホルム アルデヒドなどがあります¹。水素の製造業者 とユーザーの両方にとって、水素の品質管理、 特に異なるグレードの不純物分析は、緊急性 の高いニーズとなっています。

水素中の永久ガス不純物の分析は多く報告さ れています。

- マイクロ熱伝導度検出器と2つの分析 チャネルで構成された Agilent 990 マイク ロ GC システムは、複数の永久ガス(He、 Ne、N₂、Ar、O₂、CO、CO₂)に対し、2~ 10,000 ppm の範囲で、高速(150 秒以 内)かつ高感度の分析を実現します²。
- パルスド放電ヘリウムイオン化検出器 (PDHID) を備えた Agilent 8890 GC は、1回注入により、永久ガス不純物と二 酸化炭素を低 ppb レベルで定性的および 定量的に検出できます³。

さらに、水素中の硫黄化合物のモニタリング も、高価な触媒を保護し、製品品質を確保す るうえできわめて重要です。しかし、水素に含 まれる硫黄化合物の測定は、その高い反応 性、吸着特性、金属触媒特性により容易では ありません。信頼性に優れた、高精度な結果 を得るには、システム全体における高い不活 性度と感度の両方が必要です。このアプリケー ションノートでは、8890 GC と 8355 SCD シ ステムを使用した水素中の硫黄化合物の分析 について説明します。

実験方法

分析は、8890 GC に 8355 SCD を組み合わ せて実施しました。サンプルは、不活性ボラタ イルインタフェース (VI) に直接接続された 6 ポートガスサンプリングバルブにより導入しま した。より高い感度を獲得するために、2 mL ループを使用して、より多くのサンプルをシス テムに導入しました。最初のピークとして溶出 される、硫化水素のピーク形状を向上させる ために、スプリット注入手法が推奨されます。 また、高感度を実現するためには、小さなス プリット比が好ましいです。今回は、10:1 のス プリット比を使用して、ピーク形状と感度との バランスを図ります。機器の設定条件を表 1 に示します。

ニューマティクスコントロールモジュール (PCM)と新たに設計されたガスブレンドモ ジュール (SP-1 8890-0717 として新しい機 器で購入可能)を使用して、ppbキャリブレー ション標準を調製しました。ミニガスブレンダ と呼ばれるこのモジュールは、8890 GC の エレクトロニックニューマティクスコントロー ル (EPC)スロットに取り付ける、一体型、シ ングルステージのダイナミックフロー希釈装置 です。以前のバージョンと比較し、はるかにコ ンパクトで簡単に設置できます。望ましい濃度 を得るために、キャリブレーションガス混合物 の連続的なストリームと、ブレンダ内のマトリッ クスガスのストリームを混合します。図1 に、 サンプル希釈、導入、分析設定を示します。こ

表1.分析条件

パラメータ	值		
Agilent 8890 GC			
サンプル導入	6 ポートガスサンプリングバルブ、バルブボックス温度:150 ℃		
サンプルループ	2 mL		
注入口	ボラタイルインタフェース、スプリットモード、スプリット比 10:1、温度:150 ℃		
カラム	Agilent J&W DB-Sulfur SCD、60 m × 0.32 mm、4.2 μm (部品番号 G3903-63001)		
キャリアガス	ヘリウム、3 mL/min の定流量		
オーブンプログラム	40 ℃ (1 分間)、15 ℃ /min で 230 ℃まで昇温		
Agilent 8355 SCD			
バーナー温度	2° 008		
ベース温度	280 °C		
上部 H ₂ 流量	38 mL/min		
下部 H ₂ 流量	8 mL/min		
酸素流量(空気)	50 mL/min		
O ₃ ジェネレータ流量	44.15 mL/min		
バーナー圧力	383 Torr		
リアクションセル圧力	4.9 Torr		
データレート	5 Hz		

の実験では、希釈ガスとして高純度の水素を 使用します。希釈比はキャリブレーション混合 物フロー (F_1) とマトリックスフロー (F_2) によっ て決定されます。希釈の式は次のとおりです。

$$C_2 = C_1 \times \left(\frac{F_1}{F_1 + F_2}\right)$$

式 1.

 C_2 は希釈後濃度、 C_1 は最初のキャリブレー ション濃度、 F_1 はキャリブレーション混合ガス 流量、 F_2 は希釈マトリックスガス流量です。

硫黄ガス標準は Air Liquide から購入しま した。活性硫黄成分の吸収を最小限に抑制 するために、不活性レギュレータと不活性 チューブを使用してシステムに標準ガスボン べを接続しました。表2に、硫黄ガス標準 の組成と濃度の一覧を示します。表3に、8 つの混合ガス/希釈コンビネーション(約1 ppmの硫黄キャリブレーション混合ガスから開 始)に対し、異なるキャリブレーションレベルに おける各成分の体積濃度(v/v)を示します。

Agilent OpenLab クロマトグラフィーデータシ ステム (CDS) を使用して、GC システムを制 御し、データ取り込みと定量分析を実行しまし た。5 Hz/0.04 分のデータ取り込みレートによ り、許容可能なベースラインが得られました。

結果と考察

硫黄化合物によるシステム平衡化の実現

低濃度 (ppb) での硫黄の分析に伴う最大 の課題は、活性硫黄化合物の吸収を最小限 に抑制し、迅速にサンプル流路で硫黄の「飽 和」状態を確立することです。活性点を最小 化するために、ガスボンベレギュレータ、接続 チューブ、ミニガスブレンダ、バルブサンプル ループ、VI 注入口、分析カラム、検出器など、 サンプル流路全体を不動態化することが推奨 されます。不動態化に加え、不動態化流路で 硫黄成分を前飽和させるには、プライミングの プロセスが必要でした。プライミング時間は主 に流路のプライミングに使用したサンプル流 量とサンプル濃度に基づきます。



図 1.硫黄化合物分析のためのダイナミックブレンドシステムと Agilent 8890 GC の構成のレイアウト。 希釈の式は式 1 で定義されます。

表2.標準混合ガス (バランスガス:H₂)

No.	化合物名	式	濃度(µmol/mol、ppm)
1	硫化水素	H_2S	0.992
2	硫化カルボニル	COS	1.01
3	メチルメルカプタン	CH₃SH	0.999
4	エチルメルカプタン	C ₂ H ₅ SH	0.990
5	ジメチルスルフィド	CH ₃ SCH ₃	1.01
6	二硫化炭素	CS ₂	1.01
7	チオフェン	C_4H_4S	1.01

表 3. 希釈表(1 成分あたり約 1 ppm のキャリブレーション混合 ガスから開始)

キャリブレーション混合ガス 流量(mL/min)	PCM (H₂) 流量(mL/min)	濃度 (ppbv)
1	99	10
1	65.67	15
1	49	20
1	39	25
1	19	50
1	9	100
1	5.67	150
1	4	200

プライミングプロセスの間、システムが最初 に硫黄化合物に接触したときに、一部の化合 物でピーク面積の増大が観察されました(図 2)。このように徐々に増加する反応現象は、 硫化水素、メチルメルカプタン、エチルメル カプタンなど、反応性の高い化合物で顕著 です。この研究では、プライミングのための 標準キャリブレーション混合ガスの濃度は約 500 ppb で、2 mL/min の流速で流路内に流 しました。GC へのサンプリング前に約2時間 わたり標準混合ガスでサンプル流路をパージ しました。最初の分析では硫化水素はまった く検出されず、メチルメルカプタンとエチルメ ルカプタンは非常に低いレスポンスを示しま した。これらの化合物に対して、システムのプ ライミングのために長いシーケンスを設定しま した。プライミングが完了すると、ppb キャリ ブレーションサンプルを繰り返し注入した場合 に安定的なレスポンスを得ることができました (図3)。

さらに、プライミング手順後、最低および最高キャリブレーションレベルにおける H₂S と COS の相対レスポンスは類似していました。 このような類似性は、システムのプライミング が有効であったことを示しています。プライミ ングサンプル濃度とサンプル流量が高いほど、 より素早くサンプル流路が硫黄化合物によって 飽和されると推定されました。 プライミングされたシステムが数日間にわたり アイドル状態だった場合、通常、スタンバイ後 の最初の2~3回の注入は廃棄する必要が あります。その後の注入は定量分析に使用で きます。



図2.システムに硫黄化合物を最初に導入したときのシステム動作。各化合物の濃度は 200 ppb です。





クロマトグラム

8355 SCD は、炭化水素からの干渉なく微量 硫黄含有化合物を分析できる、選択性に優れ た検出器です。このメソッドの分析対象中のす べての硫黄に対して、直線的な等モルレスポ ンスを実現できます。揮発性、極性、反応性の 高い硫黄化合物の分析のために、4.2 µm の 非極性固定相で被覆された J&W DB-Sulfur SCD カラムを 8355 SCD に接続しました。図 4 に示すように、システム全体で、ターゲット 硫黄化合物に対し優れた分離能、優れたピー ク形状、感度の高い結果が得られます。この ような性能は、不活性流路、低ブリード、分析 カラムの優れた不活性度によるものです。100 ppb における各成分に含まれる硫黄のモルレ スポンス係数のパーセント相対標準偏差(% RSD) は 12.1 % でした。これは、硫黄に対す る 8355 SCD の等モルレスポンスを実証して います。

再現性と直線性

再現性を評価し、結果を表4に示しています。 3 つのキャリブレーションレベル(低、中、高) で、各レベルで繰り返し分析を8回実施し、 すべてのデータを取得しました。表4に示すよ うに、15 ppb キャリブラントの平均面積 RSD は7.4%で、最大で12.54%でした。15 ppb の濃度はメソッドの定量下限に非常に近く、こ のレベルでの7.4%の平均面積 RSD は非 常に優れた性能を示しています。濃度を高く すると、面積精度が大幅に向上しました。面 積 RSD は、50 ppb で1.77~3.85%、200 ppb で0.87~2.21%でした。

直線性は7種の化合物に対し、15~200 ppbの7つの濃度レベルで評価しました。硫 黄成分の相関係数(R²)は0.998以上でし た。図5にターゲット化合物のキャリブレー ションプロットを、表5に各化合物の詳細な 結果を示します。



図 4.100 ppb の濃度における硫黄標準のクロマトグラム

		面積 RSD % (n = 8)		
No.	化合物	低(15 ppb)	中(50 ppb)	高(200 ppb)
1	硫化水素	7.3	2.13	1.69
2	硫化カルボニル	4.54	3.16	2.21
3	メチルメルカプタン	5.72	3.85	1.67
4	エチルメルカプタン	7.56	2.67	1.5
5	ジメチルスルフィド	12.54	3.37	1.36
6	二硫化炭素	4.76	1.77	0.87
7	チオフェン	8.78	3.03	1.08



図 5. 分析した硫黄化合物のキャリブレーションプロット

表 5. 硫黄化合物の直線性の結果

		リテンションタイム		
No.	化合物	(分)	CF 式	R ²
1	硫化水素	3.976	y = 2.2524x + 6.0381	0.9987
2	硫化カルボニル	4.206	y = 2.8622x + 2.0716	0.9991
3	メチルメルカプタン	5.193	y = 2.4045x + 3.9397	0.9998
4	エチルメルカプタン	6.295	y = 1.9226x + 1.0020	0.9983
5	ジメチルスルフィド	6.543	y = 2.6252x - 2.1923	0.9986
6	二硫化炭素	7.013	y = 5.5277x - 9.1795	0.9993
7	チオフェン	8.997	y = 2.7757x - 0.2334	0.9991

検出下限(LOD)の評価

標準混合ガスを希釈し、7種の硫黄化合物に 対し 8355 SCD で実用的な LOD を測定しま した。図 6 のクロマトグラムに、10 ppb(図 6A) および 15 ppb (図 6B) における、標準 混合ガスに対するレスポンスを示します。すべ ての成分を、シャープなピーク形状でベースラ インノイズから分離することが可能です。S/N 比 (ASTM) を LOD の評価に使用しました。 10 ppb と 15 ppb におけるすべての成分の S/N 値を、それぞれ図 6A と図 6B に示しま す。S/N 値は3を大きく上回っています。これ は、これらの化合物の LOD が 10 ppb 未満で あるということです。図 6B で、S/N 値は 10 よりも若干高くなっています。このことから、 各成分の定量下限が約 15 ppb であると結論 付けることができます。

結論

Agilent 8355 化学発光硫黄検出器と組み合 わせた Agilent 8890 ガスクロマトグラフィー システムは、硫黄化合物の分析で、優れた直 線性と再現性を提供します。この研究では、 実用的な LOD も評価し、システム全体の優れ た感度が示されました。不活性流路、ボラタイ ルインタフェースを介して接続されたサンプル バルブ、ミニガスブレンダ、Agilent J&W DB-Sulfur SCD カラム、接続された SCD で構成 されたシステム全体の機能は、高純度水素に 含まれる微量な硫黄化合物の高精度の定性 および定量分析を実現します。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111 email_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、 医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。 本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに 変更されることがあります。

DE46212077

アジレント・テクノロジー株式会社 © Agilent Technologies, Inc. 2023 Printed in Japan, April 26, 2023 5994-5864JAJP



図 6. 低濃度における硫黄標準のクロマトグラムとシグナル/ノイズ比: (A) 10 ppb、(B) 15 ppb。 ピーク同定については図 4 を参照してください。

参考文献

- Xu, C.; Xu, G. Analysis Technology of Trace Impurities in Hydrogen for Hydrogen Fuel Cell Vehicles.*Chemical Industry and Engineering Progress* **2021**, *40(2)*, 688–702.DOI: 10.16085/ j.issn.1000-6613.2020-0690.
- Bu, T. Hydrogen Impurity Analysis Using the Agilent 990 Micro GC.Agilent Technologies application note, publication number 5994-2138EN, 2020.
- Li, W. Analysis of Trace Carbon Dioxide and Permanent Gas Impurities in Fuel Cell Hydrogen and High-Purity Hydrogen Using the Agilent 8890 GC-PDHID System (in Chinese). Agilent Technologies application note, publication number 5994-4045ZHCN, 2021.

